

REC'D	18	NOV 2	2004
WIPO	7		PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2004年 2月26日

出 願 番 号 Application Number:

人

特願2004-052194

[ST. 10/C]:

[JP2004-052194]

出 願 Applicant(s):

パイオニア株式会社

12-1----

PRIORITY DOCUMENT

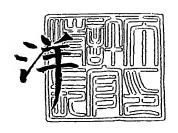
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

5 日

2004年11月

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

1) 11]





【書類名】 特許願 【整理番号】 58P0892 【あて先】 特許庁長官殿

【発明者】

【国際特許分類】

【住所又は居所】 山梨県中巨摩郡田富町西花輪2680番地 パイオニア株式会社

内

H01J 11/00

【氏名】 林海

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県中巨摩郡田富町西花輪2680番地 パイオニア株式会社

内

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県中巨摩郡田富町西花輪2680番地 パイオニア株式会社

内

【氏名】 直井 太郎

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県中巨摩郡田富町西花輪2680番地 パイオニア株式会社

内

【氏名】 佐々木 健

【特許出願人】

【識別番号】 000005016

【氏名又は名称】 パイオニア株式会社

【代理人】

【識別番号】 100063565

【弁理士】

【氏名又は名称】 小橋 信淳

【選任した代理人】

【識別番号】 100118898

【弁理士】

【氏名又は名称】 小橋 立昌

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2003-335866 【出願日】 平成15年 9月26日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011659 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

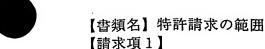
【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1

 【包括委任状番号】
 0106460



放電空間を介して対向する前面基板および背面基板と、この前面基板と背面基板の間に 複数の行電極対およびこの行電極対に対して交差する方向に延びて行電極対との各交差部 分の放電空間にそれぞれ単位発光領域を形成する複数の列電極が設けられているプラズマ ディスプレイパネルにおいて、

前記前面基板と背面基板の間の単位発光領域に面する部分に、立方体の多重結晶構造の酸化マグネシウム単結晶体粉末を含む酸化マグネシウム層が設けられていることを特徴とするプラズマディスプレイパネル。

【請求項2】

前記酸化マグネシウム単結晶体粉末が、粒径500オングストローム以上の単結晶体粉末を含んでいる請求項1に記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項3】

前記酸化マグネシウム単結晶体粉末が、粒径2000オングストローム以上の単結晶体 粉末を含んでいる請求項1に記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項4】

前記酸化マグネシウム単結晶体粉末が、マグネシウムが加熱されて発生されるマグネシウム蒸気が気相酸化されることによって生成される単結晶体粉末を含んでいる請求項1に記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項5】

前記酸化マグネシウム単結晶体粉末が、電子線によって励起されて波長域200~30 0nm内にピークを有するカソードルミネッセンス発光を行う請求項1記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項6】

前記酸化マグネシウム層が、行電極対を被覆する誘電体層上に形成されている請求項1 に記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項7】

前記単位発光領域が、画像形成のための発光が行われる第1発光領域と、この画像形成のための発光を発生させる第1発光領域を選択するための放電が行われる第2発光領域とに区画され、前記酸化マグネシウム層が単位発光領域の第2発光領域に面する部分に設けられている請求項1に記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項8】

放電空間を介して対向される前面基板および背面基板と、この前面基板および背面基板のうちの少なくとも一方の基板に形成された電極と、この電極を被覆する誘電体層と、この誘電体層の所要の部分を被覆する酸化マグネシウム層とを有するプラズマディスプレイパネルの製造方法であって、

前記酸化マグネシウム層を、立方体の多重結晶構造の酸化マグネシウム単結晶体粉末を含むペーストを誘電体層の所要の部分に塗布することによって形成することを特徴とするプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項9】

前記酸化マグネシウム単結晶体粉末が、500オングストローム以上の単結晶体粉末を 含んでいる請求項8に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項10】

前記酸化マグネシウム単結晶体粉末が、2000オングストローム以上の単結晶体粉末を含んでいる請求項8に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項11】

前記酸化マグネシウム単結晶体粉末が、マグネシウムが加熱されて発生されるマグネシウム蒸気が気相酸化されることによって生成される単結晶体粉末を含んでいる請求項8に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項12】

放電空間を介して対向される前面基板および背面基板と、この前面基板および背面基板 のうちの少なくとも一方の基板に形成された電極と、この電極を被覆する誘電体層と、こ の誘電体層の所要の部分を被覆する酸化マグネシウム層とを有するプラズマディスプレイ パネルの製造方法であって、

前記酸化マグネシウム層を、立方体の多重結晶構造の酸化マグネシウム単結晶体粉末を 誘電体層に吹き付けて付着させることにより形成することを特徴とするプラズマディスプ レイパネルの製造方法。

【請求項13】

前記酸化マグネシウム単結晶体粉末が、500オングストローム以上の単結晶体粉末を 含んでいる請求項12に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項14】

前記酸化マグネシウム単結晶体粉末が、2000オングストローム以上の単結晶体粉末 を含んでいる請求項12に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】プラズマディスプレイパネルおよびその製造方法

【技術分野】

[0001]

この発明は、プラズマディスプレイパネルの構成およびプラズマディスプレイパネルの 製造方法に関する。

【背景技術】

[0002]

面放電方式交流型プラズマディスプレイパネル(以下、PDPという)は、放電ガスが 封入されている放電空間を挟んで互いに対向される二枚のガラス基板のうち、一方のガラ ス基板に行方向に延びる行電極対が列方向に並設され、他方のガラス基板に列方向に延び る列電極が行方向に並設されていて、放電空間の行電極対と列電極がそれぞれ交差する部 分に、マトリックス状に単位発光領域(放電セル)が形成されている。

[0003]

そして、このPDPには、行電極や列電極を被覆するために形成された誘電体層上の単 位発光領域内に面する位置に、誘電体層の保護機能と単位発光領域内への2次電子放出機 能とを有する酸化マグネシウム(MgO)膜が形成されている。

[0004]

このようなPDPの製造工程における酸化マグネシウム膜の形成方法としては、酸化マ グネシウム粉末を混入したペーストを誘電体層上に塗布することによって形成するスクリ ーン印刷法が、簡便な手法であることから、その採用が検討されている(例えば、特許文 献1参照)。

[0005]

しかしながら、特許文献1のように、水酸化マグネシウムを熱処理して精製した多結晶 片葉形の酸化マグネシウムを混入したペーストを用いて、スクリーン印刷法によってPD Pの酸化マグネシウム膜を形成する場合には、PDPの放電特性は、蒸着法によって酸化 マグネシウム膜を形成する場合とほとんど同じかまたは僅かに向上する程度に過ぎない。

[0006]

このため、放電特性をより一層向上させることが出来る酸化マグネシウム膜(保護膜) をPDPに形成出来るようにすることが要望されている。

【特許文献1】特開平6-325696号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

この発明は、上記のような従来の酸化マグネシウム膜が形成されるPDPにおける問題 点を解決することをその解決課題の一つとしている。

【課題を解決するための手段】

[0009]

第1の発明(請求項1に記載の発明)によるプラズマディスプレイパネルは、上記課題 を解決するために、放電空間を介して対向する前面基板および背面基板と、この前面基板 と背面基板の間に複数の行電極対およびこの行電極対に対して交差する方向に延びて行電 極対との各交差部分の放電空間にそれぞれ単位発光領域を形成する複数の列電極が設けら れているプラズマディスプレイパネルにおいて、前記前面基板と背面基板の間の単位発光 領域に面する部分に、立方体の多重結晶構造の酸化マグネシウム単結晶体粉末を含む酸化 マグネシウム層が設けられていることを特徴としている。

[0010]第2の発明(請求項8に記載の発明)によるプラズマディスプレイパネルの製造方法は 、放電空間を介して対向される前面基板および背面基板と、この前面基板および背面基板 のうちの少なくとも一方の基板に形成された電極と、この電極を被覆する誘電体層と、こ

の誘電体層の所要の部分を被覆する酸化マグネシウム層とを有するプラズマディスプレイ パネルの製造方法であって、前記酸化マグネシウム層を、立方体の多重結晶構造の酸化マ グネシウム単結晶体粉末を含むペーストを誘電体層の所要の部分に塗布することによって 形成することを特徴としている。

【発明を実施するための最良の形態】

この発明によるPDPは、前面ガラス基板と背面ガラス基板の間に、行方向に延びる行 [0011] 電極対と、列方向に延びて行電極対との交差部分の放電空間に放電セル(単位発光領域) を形成する列電極が設けられ、この放電セルに面する部分に、酸化マグネシウム層が、立 方体の多重結晶構造の酸化マグネシウム単結晶体粉末を含むペーストをスクリーン印刷法 またはオフセット印刷法、ディスペンサ法、インクジェット法、ロールコート法などの方 法による塗布によって、または、酸化マグネシウム単結晶体粉末をスプレー法や静電塗布 法などの方法による付着によって、形成されているPDPをその最良の実施形態としてい る。

[0012]

この実施形態におけるPDPは、放電セルに面する部分に設けられた酸化マグネシウム 層が、立方体の多重結晶構造の酸化マグネシウム単結晶体を含んでいることにより、PD Pにおける放電確率や放電遅れなどの放電特性が改善されて、良好な放電特性を得ること が出来る。

【実施例1】

[0013]

図1ないし4は、この発明の実施形態における第1の実施例を示している。

[0014]

図1は、この第1実施例における面放電方式交流型PDPのセル構造を模式的に示す正 面図であり、図2は図1のV1-V1線における断面図、図3は図1のV2-V2線にお ける断面図、図4は図1のW1-W1線における断面図である。

[0015]この図1ないし4において、PDPは、表示面である前面ガラス基板1の背面に、複数 の行電極対(X, Y)が、前面ガラス基板1の行方向(図1の左右方向)に延びるととも に列方向(図1の上下方向)に並設されている。

行電極Xは、T字形状に形成されたITO等の透明導電膜からなる透明電極Xaと、前 面ガラス基板1の行方向に延びて透明電極Xaの幅が小さい基端部に接続された金属膜か らなる黒色のバス電極Xbによって構成されている。

[0017]

行電極Yも同様に、T字形状に形成されたITO等の透明導電膜からなる透明電極Ya と、前面ガラス基板 1 の行方向に延びて透明電極 Y a の幅が小さい基端部に接続された金 属膜からなる黒色のバス電極Ybと、透明電極Yaと一体的に形成されてバス電極Ybに 対してこの透明電極Yaの基端部から反対側に突出するアドレス放電透明電極Ycとによ って構成されている。

この行電極XとYは、前面ガラス基板1の列方向(図1の上下方向、および、図2の左 右方向)に交互に配置されており、バス電極ХЬとУЬに沿って等間隔に並列されたそれ ぞれの透明電極XaとYaが、互いに対となる相手の行電極側に延びて、この透明電極X aとYaの幅が広い先端部が、それぞれ所要の幅の放電ギャップgを介して互いに対向さ れている。

そして、行電極Yのアドレス放電透明電極Ycが、列方向において隣接する他の行電極 対(X, Y)の間隔を開けて互いに背中合わせに位置されている行電極Xのバス電極Xb と行電極Yのバス電極Ybとの間に、それぞれ位置されている。

[0020]

この各行電極対(X, Y)ごとに、それぞれ、行方向に延びる表示ラインLが構成され ている。

[0021]

前面ガラス基板 1 の背面には、行電極対 (X, Y) を被覆するように誘電体層 2 が形成 されており、この誘電体層2の背面側には、行方向において互いに隣接している行電極対 (X, Y) の互いに背中合わせに位置するバス電極 X b と Y b 、および、この背中合わせ のバス電極XbとYbの間の領域部分(アドレス放電透明電極Ycが位置している部分) に対向する位置に、誘電体層2から背面側(図2において下方側)に向かって突出する黒 色または暗色の第1嵩上げ誘電体層3Aが、バス電極Xb,Ybと平行に延びるように形 成されている。

[0022]

さらに、この第1嵩上げ誘電体層3Aの背面のバス電極Xbに対向する部分に、第1嵩 上げ誘電体層3Aから背面側(図2において下方側)に向かって突出する第2嵩上げ誘電 体層3Bが、バス電極Xbと平行に延びるように形成されている。

[0023]

この誘電体層2と第1嵩上げ誘電体層3A,第2嵩上げ誘電体層3Bの背面側表面は、 酸化マグネシウム(MgO)からなる図示しない保護層によって被覆されている。

前面ガラス基板1と放電空間を介して平行に配置された背面ガラス基板4の前面ガラス 基板1と対向する側の面上には、複数の列電極Dが、各行電極対(X, Y) の互いに対と なった透明電極 X a および Y a にそれぞれ対向する位置においてバス電極 X b , Y b と直 交する方向(列方向)に延びるように、互いに所定の間隔を開けて平行に配列されている

[0025]この背面ガラス基板4の前面ガラス基板1に対向する側の面上には、さらに、列電極D を被覆する列電極保護層(誘電体層) 5 が形成され、この列電極保護層 5 上に、下記に詳 述するような形状の隔壁6が形成されている。

[0026]

すなわち、この隔壁 6 は、前面ガラス基板 1 側から見て、各行電極 X のバス電極 X b と 対向する位置においてそれぞれ行方向に延びる第1横壁6Aと、行電極X,Yのバス電極 Xb, Ybに沿って等間隔に配置された各透明電極Xa, Yaの間の位置においてそれぞ れ列方向に延びる縦壁 6 Bと、各行電極Yのバス電極Ybと対向する位置においてそれぞ れ第1横壁6Aと所要の間隔を空けて平行に延びる第2横壁6Cとによって構成されてい る。

[0027]

そして、これら第1横壁6Aおよび縦壁6B, 第2横壁6Cの高さは、第2嵩上げ誘電 体層3Bの背面側を被覆している保護層と列電極Dを被覆している列電極保護層5との間 の間隔に等しくなるように設定されている。

[0028]

これによって、隔壁6の第1横壁6Aの表側の面(図2において上側の面)が第2嵩上 げ誘電体層 3 B を被覆している保護層に当接されている。

[0029]

この隔壁6の第1横壁6Aと縦壁6B,第2横壁6Cによって、前面ガラス基板1と背 面ガラス基板4の間の放電空間が、それぞれ、互いに対向されて対になっている透明電極 XaとYaに対向する領域ごとに区画されて表示放電セル(第1発光領域)C1が形成さ れ、さらに、第1横壁6Aと第2横壁6Cに挟まれて互いに隣接する行電極対(X, Y) の背中合わせに位置するバス電極 X b と Y b の間の領域に対向する部分の空間が、縦壁 6 Bによって区画されることによって、それぞれ表示放電セルC1と列方向において互い違 いに配置されるアドレス放電セル(第2発光領域)C2が形成されている。

[0030]

このアドレス放電セルC2は、行電極Yのアドレス放電透明電極Ycに対向されている

[0031]

そして、列方向において第2横壁6Cを挟んで隣接する表示放電セルC1とアドレス放 電セルC2とは、それぞれ、第1嵩上げ誘電体層3Aを被覆している保護層と第2横壁6 Cとの間に形成される隙間rを介して互いに連通されている。

[0032]

各表示放電セルC1内の放電空間に面する隔壁6の第1横壁6Aおよび縦壁6B, 第2 横壁6Cの各側面と列電極保護層5の表面には、これらの五つの面をほぼ全て覆うように 蛍光体層 7 が形成されており、この蛍光体層 7 の色は、各表示放電セルC 1 毎に赤(R) , 緑 (G) , 青 (B) の色が行方向に順に並ぶように配列されている。

[0033]

また、各アドレス放電セルC2内の放電空間に面する隔壁6の第1横壁6Aおよび縦壁 6B, 第2横壁6Cの各側面と列電極保護層5の表面には、これらの五つの面をほぼ全て 覆うように、後で詳述するような気相法酸化マグネシウム単結晶体を含む酸化マグネシウ ム (MgO) 層8が形成されている。

[0034]

表示放電セルC1およびアドレス放電セルC2内には、キセノンを含む放電ガスが封入 されている。

[0035]

上記PDPの酸化マグネシウム層8は、下記の材料および方法によって形成されている

[0036]

すなわち、この酸化マグネシウム層8の形成材料となる気相法酸化マグネシウム単結晶 体とは、マグネシウムを加熱して発生するマグネシウム蒸気を気相酸化して得られるマグ ネシウム粉末であり、図5のSEM写真像に示されるように、立方体構造ではなく、立方 体の結晶体が互いに嵌り込んだ構造(すなわち、立方体の多重結晶構造)を有する酸化マ グネシウム単結晶体である。

[0037]

この多重結晶構造の酸化マグネシウム単結晶体は、結晶面欠陥を多数含んでおり、後述 するように、この面欠陥エネルギ準位の存在が放電遅れの減少などの放電特性の改善に寄 与する。

[0038]

そして、この気相法によって得られる多重結晶構造の酸化マグネシウム単結晶体は、他 の方法によって得られるものと比較すると、高純度であるとともに微粒子が得られ、さら に、粒子の凝集が少ないなどの特徴を備えている。

[0039]

この実施例においては、立方体構造の結晶が相互に合体した多重結晶構造を有し、BE T法によって測定した平均粒径が500オングストローム(Å)以上の気相法酸化マグネ シウム単結晶体が用いられる。

[0040]

この酸化マグネシウム層8は、気相法酸化マグネシウム単結晶体の粉末を含有するペー ストが、スクリーン印刷法またはオフセット印刷法、ディスペンサ法、インクジェット法 ,ロールコート法などの方法によってアドレス放電セルC 2 内の放電空間に面する隔壁 6 の第1横壁6Aおよび縦壁6B,第2横壁6Cの各側面と列電極保護層5の表面に塗布さ れたり、または、気相法酸化マグネシウム単結晶体粉末がスプレー法や静電塗布法などの 方法によって付着されることにより形成される。

[0041]

上記PDPは、画像形成の際に、先ず、表示放電セルC1およびアドレス放電セルC2

内においてリセット放電が行われた後、アドレス放電セルC2内において、行電極Yのア ドレス放電透明電極Ycと列電極Dとの間でアドレス放電が行われる。

[0042]

このアドレス放電セルC2内のアドレス放電によって発生した荷電粒子は、第1嵩上げ 誘電体層3Aと第2横壁6Cとの間の隙間rを通って表示放電セルC1内に導入され、こ の荷電粒子によって、壁電荷が形成されている表示放電セルC1(発光セル)と壁電荷が 形成されていない表示放電セルC1(非発光セル)とが、形成する画像に対応してパネル 面に分布される。

[0043]

そして、このアドレス放電の後、各発光セル内において行電極対(X, Y)の透明電極 Xaと透明電極 Yaの間で維持放電が発生されることにより、赤 (R),緑 (G),青(B) の蛍光体層 7 が発光して、パネル面に画像が形成される。

上記PDPは、アドレス放電が蛍光体層 7.を発光させるための維持放電が行われる表示 放電セルC1とは区画されたアドレス放電セルC2内において行われるようになっている ことにより、アドレス放電が、蛍光材料の色ごとに異なる放電特性や製造工程において生 じる蛍光体層の厚さのばらつきなどの蛍光体層に起因した影響を受けることがなくなり、 安定したアドレス放電特性を得ることが出来る。

[0045]

さらに、上記PDPは、アドレス放電の前に行われるリセット放電時に、アドレス放電 セルC2内においても放電が発生され、この放電によって放電ガスのキセノンから真空紫 外線が放射されて、この真空紫外線により、アドレス放電セルC2内に形成されている酸 化マグネシウム層8から2次電子(プライミング粒子)が放出されることによって、アド レス放電のアドレス放電開始電圧が低下されるとともにアドレス放電が高速化される。

[0046]

そしてさらに、上記PDPは、図6および7に示されるように、アドレス放電セルC2 内の酸化マグネシウム層8が、上述したように、立方体の多重結晶構造の気相法酸化マグ ネシウム単結晶体を含んでいることにより、アドレス放電による電子線の照射によって、 酸化マグネシウム層8に含まれる粒径の大きな気相法酸化マグネシウム単結晶体から、3 00~400 nmにピークを有するCL (カソードルミネッセンス) 発光に加えて、23 5 nmにピークを有するCL発光(波長域180~300 nm)が励起される。

[0047]

この235nmにピークを有するCL発光は、図8に示されるように、通常の蒸着法に よって形成される酸化マグネシウム層からは励起されず、300~400nmにピークを 有するCL発光のみが励起される。

[0048]

また、図6および7から分かるように、235nmにピークを有するCL発光(波長域 180~300 nm)は、気相法酸化マグネシウム単結晶体粉末の粒径が大きくなるほど そのピーク強度が大きくなる。

[0049]

なお、酸化マグネシウム層 8 を形成する気相法酸化マグネシウム単結晶体粉末の粒子径 (DBET) は、窒素吸着法によってBET比表面積(s)が測定され、この値から次式 によって算出される。

[0050]

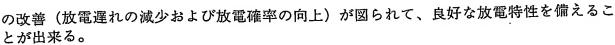
 $D_{BET} = A / s \times \rho$

A:形状計数(A=6)

ρ:マグネシウムの真密度

以上のように、酸化マグネシウム層8が、立方体の多重結晶構造を有しBET法によっ て測定した平均粒径が500オングストローム(Å)以上の気相法酸化マグネシウム単結 晶体粉末を含んでいることによって、上記PDPは、放電確率や放電遅れなどの放電特性

出証特2004-3099994



[0051]

図9は、アドレス放電セルC2内に設けられる酸化マグネシウム層を、平均粒径が200~3000オングストローム (A) の気相法酸化マグネシウム単結晶体粉末を含むペーストを塗布することによって形成した場合と、従来の蒸着法によって形成した場合と、形成しなかった場合におけるそれぞれの放電確率を比較したグラフであり、図10は、図9において放電の休止時間が1000μsecの場合のそれぞれの放電確率を示している

[0052]

さらに、図11は、同様に、アドレス放電セルC2内に設けられる酸化マグネシウム層を、平均粒径が2000~3000オングストローム(Å)の気相法酸化マグネシウム単結晶体粉末を含むペーストを塗布することによって形成した場合と、従来の蒸着法によって形成した場合と、形成しなかった場合のそれぞれの放電遅れ時間を比較したグラフであり、図12は、図11において放電の休止時間が1000μsecの場合のそれぞれの放電遅れ時間を示している。

[0053]

この図9ないし12から、酸化マグネシウム層8が気相法酸化マグネシウム単結晶体粉末を含んでいることによって、上記PDPの放電確率や放電遅れが大幅に改善され、さらに、放電遅れの休止時間依存性が減少されて、良好な放電特性を備えることが分かる。

[0054]

図13は、酸化マグネシウム層8を形成する気相法酸化マグネシウム単結晶体の粒径と 放電確率の関係を示すグラフである。

[0055]

この図13から、酸化マグネシウム層8を形成する気相法酸化マグネシウム単結晶体の 粒径が大きいほど放電確率が高く、上記したような235nmにピークを有するCL発光 が励起される粒径(図示の例では、2000オングストロームと3000オングストローム)の気相法酸化マグネシウム単結晶体によって形成された酸化マグネシウム層8が、大幅に放電確率を向上させていることが分かる。

[0056]

なお、このような放電特性の改善は、前述したように、酸化マグネシウム層 8 を形成する立方体の多重結晶構造の気相法酸化マグネシウム単結晶体が結晶面欠陥を多く含んでいて、その面欠陥エネルギ準位によって為されるものと推測される。

[0057]

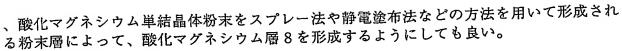
そして、この立方体の多重結晶構造の気相法酸化マグネシウム単結晶体の粒径が大きいほど放電特性の改善効果が大きくなるのは、大きな粒径の気相法酸化マグネシウム単結晶体を形成しようとする場合には、マグネシウムを加熱してマグネシウム蒸気を発生させる際の加熱温度を高くする必要があるので、マグネシウムと酸素が反応する火炎の長さが長くなり、この火炎と周囲との温度差が大きくなることによって、粒径の大きい多重結晶構造の気相法酸化マグネシウム単結晶体ほど結晶面欠陥が沢山形成されるためである。

[0058]

しかしながら、図13から、平均粒径が500オングストローム(A)程度の気相法酸化マグネシウム単結晶体粉末を含むペーストをスクリーン印刷法またはオフセット印刷法,ディスペンサ法,インクジェット法,ロールコート法等の方法を用いて塗布することによって酸化マグネシウム層8を形成した場合でも、従来の蒸着酸化マグネシウム層に比べて放電確率が大幅に向上していることが分かる。

[0059]

なお、上記の図6ないし13の結果は、立方体の多重結晶構造の酸化マグネシウム単結晶体粉末を含むペーストを、スクリーン印刷法またはノズル塗布,インクジェット法などの方法によって塗布することにより酸化マグネシウム層8を形成した場合のものであるが



[0060]

また、上記の実施例においては、立方体の多重結晶構造の酸化マグネシウム単結晶体粉 末を含むペーストをアドレス放電セル内に塗布して酸化マグネシウム層8を形成する例が 示されているが、前面基板側の誘電体層2を覆うように酸化マグネシウム単結晶体粉末を 含むペーストを塗布して保護層を形成するようにしても良い。

[0061]

さらに、前面基板側の誘電体層 2 上に蒸着法によって従来の酸化マグネシウム膜を形成 し、その上に立方体の多重結晶構造の酸化マグネシウム単結晶体粉末を含むペーストを塗 布して2層目のMgO膜を形成するようにしても良い。

【実施例2】

[0062]

図14ないし16は、この発明によるPDPの実施形態の第2実施例を示しており、図 14はこの第2実施例におけるPDPを模式的に示す正面図、図15は図14のV3-V 3線における断面図、図16は図14のW2-W2線における断面図である。

[0063]

この図14ないし16に示されるPDPは、表示面である前面ガラス基板10の背面に 、複数の行電極対(X1,Y1)が、前面ガラス基板10の行方向(図14の左右方向) に延びるように平行に配列されている。

[0064]

行電極X1は、T字形状に形成されたITO等の透明導電膜からなる透明電極X1aと 、前面ガラス基板10の行方向に延びて透明電極X1aの狭小の基端部に接続された金属 膜からなるバス電極X1bとによって構成されている。

[0065]

行電極Ylも同様に、T字形状に形成されたITO等の透明導電膜からなる透明電極Y 1 a と、前面ガラス基板 1 0 の行方向に延びて透明電極 Y 1 a の狭小の基端部に接続され た金属膜からなるバス電極Y1bとによって構成されている。

[0066]

この行電極X1とY1は、前面ガラス基板10の列方向(図14の上下方向)に交互に 配列されており、バス電極X1bとY1bに沿って並列されたそれぞれの透明電極X1a とY1aが、互いに対となる相手の行電極側に延びて、透明電極X1aとY1aの幅広部 の頂辺が、それぞれ所要の幅の放電ギャップglを介して互いに対向されている。

[0067]

前面ガラス基板10の背面には、列方向において隣接する行電極対(X1,Y1)の互 いに背中合わせになったバス電極 X 1 b と Y 1 b の間に、このバス電極 X 1 b, Y 1 b に 沿って行方向に延びる黒色または暗色の光吸収層(遮光層)11が形成されている。

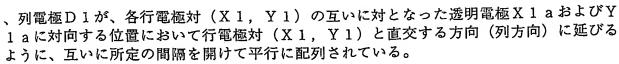
[0068]

さらに、前面ガラス基板10の背面には、行電極対(X1, Y1)を被覆するように誘 電体層12が形成されており、この誘電体層12の背面には、互いに隣接する行電極対(X1, Y1) の背中合わせに位置するバス電極X1bおよびY1bに対向する位置および この背中合わせに位置するバス電極X1bとバス電極Y1bの間の領域部分に対向する位 置に、誘電体層12の背面側に突出する嵩上げ誘電体層12Aが、バス電極X1b,Y1 bと平行に延びるように形成されている。

[0069]

そして、この誘電体層12と嵩上げ誘電体層12Aの背面側には、後述するような気相 法酸化マグネシウム (MgO) 単結晶体粉末を含む酸化マグネシウム層 13が形成されて いる。

[0070] 一方、前面ガラス基板10と平行に配置された背面ガラス基板14の表示側の面上には 出証特2004-3099994



[0071]

背面ガラス基板14の表示側の面上には、さらに、列電極D1を被覆する白色の列電極保護層15が形成され、この列電極保護層15上に、隔壁16が形成されている。

[0072]

この隔壁16は、各行電極対(X1, Y1)のバス電極X1bとY1bに対向する位置においてそれぞれ行方向に延びる一対の横壁16Aと、隣接する列電極D1の間の中間位置において一対の横壁16A間を列方向に延びる縦壁16Bとによって梯子形状に形成されており、各隔壁16が、隣接する他の隔壁16の背中合わせに対向する横壁16Aとの間において行方向に延びる隙間SLを介して、列方向に並設されている。

[0073]

そして、この梯子状の隔壁16によって、前面ガラス基板10と背面ガラス基板13の間の放電空間Sが、各行電極対(X1, Y1)において対になっている透明電極X1a, Y1aに対向する部分毎に方形に区画されて、放電セルC3がそれぞれ形成されている。

[0074]

放電セルC3に面する隔壁16の横壁16Aおよび縦壁16Bの側面と列電極保護層15の表面には、これらの五つの面を全て覆うように蛍光体層17が形成されており、この蛍光体層17の色は、各放電セルC3毎に赤,緑,青の三原色が行方向に順に並ぶように配列されている。

[0075]

高上げ誘電体層12Aは、この嵩上げ誘電体層12Aを被覆している酸化マグネシウム層13が隔壁16の横壁16Aの表示側の面に当接される(図15参照)ことによって、放電セルC3と隙間SLの間がそれぞれ閉じられているが、縦壁16Bの表示側の面は酸化マグネシウム層13に当接されておらず(図16参照)、その間に隙間r1が形成されて、行方向において隣接する放電セルC3がこの隙間r1を介して互いに連通されている

[0076]

放電空間S内には、キセノンガスを含む放電ガスが封入されている。

[0077]

上記酸化マグネシウム層13は、第1実施例の場合と同様に、図5のSEM写真像に示されるような、マグネシウムを加熱して発生するマグネシウム蒸気を気相酸化して得られる立方体の多重結晶構造を有する酸化マグネシウム単結晶体粉末を含むペーストが、スクリーン印刷法またはオフセット印刷法,ディスペンサ法,インクジェット法,ロールコート法などの方法によって誘電体層12および嵩上げ誘電体層12Aの表面に塗布されたり、または、気相法酸化マグネシウム単結晶体粉末がスプレー法や静電塗布法などの方法によって誘電体層12および嵩上げ誘電体層12Aの表面に付着されたりすることによって形成される。

[0078]

図17は、気相法酸化マグネシウム単結晶体粉末を含むペーストがスクリーン印刷法またはオフセット印刷法,ディスペンサ法,インクジェット法,ロールコート法などの方法によって塗布されることによって、酸化マグネシウム層13(A)が形成されている状態を示している。

[0079]

また、図18は、気相法酸化マグネシウム単結晶体粉末がスプレー法または静電塗布法などの方法によって付着された粉末層によって、酸化マグネシウム層13 (B) が構成されている状態を示している。

上記のPDPは、画像形成のためのリセット放電およびアドレス放電,維持放電が放電セルC3内において行われる。

[0080]

そして、アドレス放電の前に行われるリセット放電時に、このリセット放電によって放電ガス中のキセノンから真空紫外線が放射されて、この真空紫外線により、放電セルC3に面するように形成されている酸化マグネシウム層13から2次電子(プライミング粒子)が放出されることにより、次のアドレス放電時に、そのアドレス放電開始電圧が低下され、さらに、そのアドレス放電が高速化される。

[0081]

図19は、酸化マグネシウム単結晶体粉末を例えば特定のアルコールなどの媒体に分散させ、この懸濁液をスプレーガンを用いてエアースプレー法によって誘電体層12および 嵩上げ誘電体層12Aの表面に吹き付けて酸化マグネシウム単結晶体粉末を付着させることによって酸化マグネシウム層13を形成した場合の放電遅れ時間を、他の例の場合の放 電遅れ時間と比較したグラフである。

[0082]

この図14において、グラフaは、平均粒径が500オングストローム(A)の気相法酸化マグネシウム単結晶体粉末よる粉末層を誘電体層12の表面に形成した場合の放電確率を示しており、グラフbは、従来の蒸着法によって酸化マグネシウム層を誘電体層12の表面に形成した場合の放電確率を示しており、グラフcは、第1実施例のように、放電セルが表示放電セルとアドレス放電セルに分割されているタイプのPDPにおいて、アドレス放電セル内に平均粒径が500オングストローム(A)の酸化マグネシウム単結晶体粉末を含むペーストの塗布によって酸化マグネシウム層を形成した場合の放電確率を示しており、グラフdが、同様のタイプのアドレス放電セル内に、従来の蒸着法を用いて酸化マグネシウム層を形成した場合の放電確率を示している。

[0083]

この図14のグラフaとcの比較から、酸化マグネシウム層13を気相法酸化マグネシウム単結晶体粉末の付着によって形成した粉末層によって構成した場合の放電確率(放電遅れ)についても、酸化マグネシウム層を酸化マグネシウム単結晶体粉末を含むペーストの塗布によって形成した場合とほぼ同等の特性を得ることが出来ることが分かる。

[0084]

さらに、この図14から、平均粒径が500オングストローム(A)程度の気相法酸化マグネシウム単結晶体粉末を用いて、スクリーン印刷法またはオフセット印刷法,ディスペンサ法,インクジェット法,ロールコート法等の方法による塗布によって酸化マグネシウム層を形成した場合、および、スプレー法または静電塗布法等の方法による付着によって酸化マグネシウム層を形成した場合の何れの場合にも、従来の蒸着法を用いて酸化マグネシウム層を形成した場合と比べて、放電確率が大幅に向上していることが分かる。

【図面の簡単な説明】

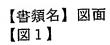
[0085]

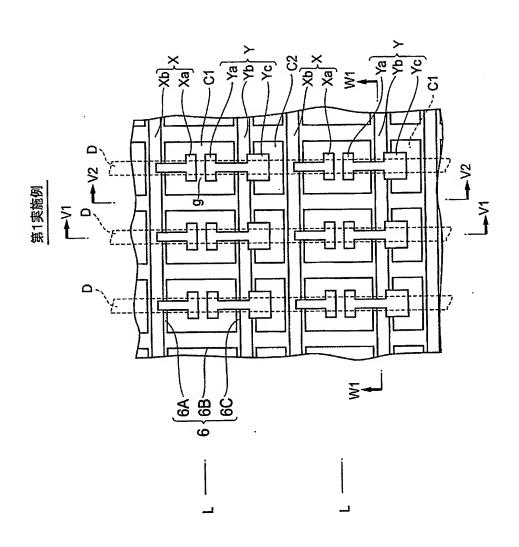
- 【図1】この発明の実施形態の第1実施例を示す正面図である。
- 【図2】図1のV1-V1線における断面図である。
- 【図3】図1のV2-V2線における断面図である。
- 【図4】図1のW1-W1線における断面図である。
- · 【図5】立方体の多重結晶構造を有する酸化マグネシウム単結晶体のSEM写真像を示す図である。
 - 【図 6 】第 1 実施例において酸化マグネシウム単結晶体粉末の粒径とC L 発光の波長との関係を示すグラフである。
 - 【図7】同例において酸化マグネシウム単結晶体粉末の粒径と235nmのCL発光 の強度との関係を示すグラフである。
 - 【図8】蒸着法による酸化マグネシウム層からのCL発光の波長の状態を示すグラフである。 ·
 - 【図9】同例における放電確率の改善の状態を示すグラフである。
 - 【図10】同例における放電確率の改善の状態を示す表図である。

- 【図11】同例における放電遅れの改善の状態を示すグラフである。
- 【図12】同例における放電遅れの改善の状態を示す表図である。
- 【図13】同例において酸化マグネシウム単結晶体粉末の粒径と放電確率との関係を 示すグラフである。
 - 【図14】この発明の実施形態の第2実施例を示す正面図である。
 - 【図15】図14のV3-V3線における断面図である。
 - 【図16】図14のW2-W2線における断面図である。
- 【図17】同例において酸化マグネシウム単結晶体粉末を含むペーストの塗布によっ て形成された酸化マグネシウム層の状態を示す断面図である。
- 【図18】同例において酸化マグネシウム単結晶体粉末の付着による粉末層によって 形成された酸化マグネシウム層の状態を示す断面図である。
- 【図19】同例において酸化マグネシウム層を酸化マグネシウム単結晶体粉末による 粉末層によって形成した場合の放電確率と他の例における放電確率との比較を示すグ ラフである。

D, D1

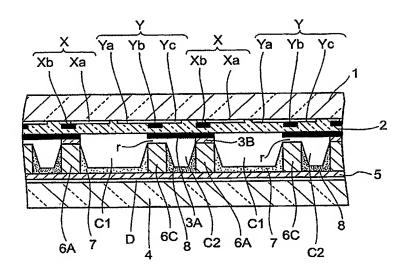
・号の説明】	
[0086]	
1, 10	…前面ガラス基板(前面基板)
4, 14	…背面ガラス基板(背面基板)
8, 13	…酸化マグネシウム層
C 1	…表示放電セル(単位発光領域,第1発光領域)
C 2	…アドレス放電セル(単位発光領域,第2発光領域)
C 3	…放電セル(単位発光領域)
X, Y, X1, Y1	…行電極(電極)
D. D1	…列電極(電極)





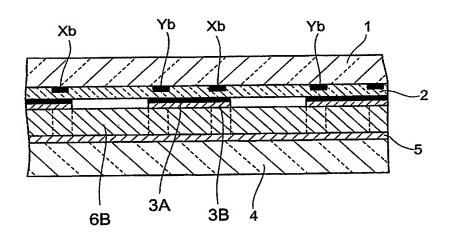
【図2】

V1-V1断面



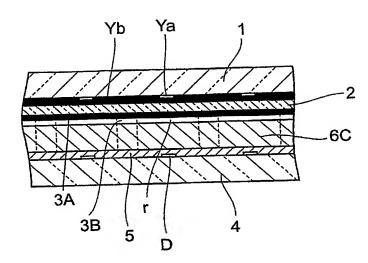
【図3】

V2-V2断面



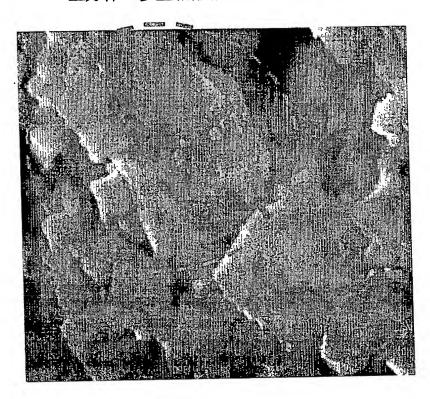
【図4】

W1-W1断面

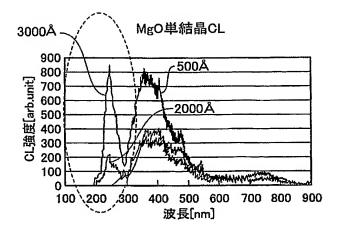


【図5】

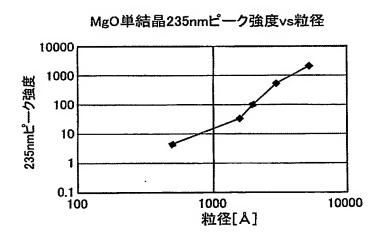
立方体の多重結晶構造の単結晶MgO



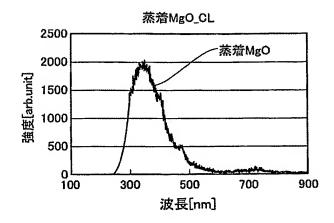




【図7】

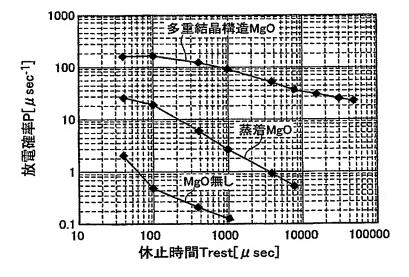


【図8】



【図9】

多重結晶構造放電確率 P





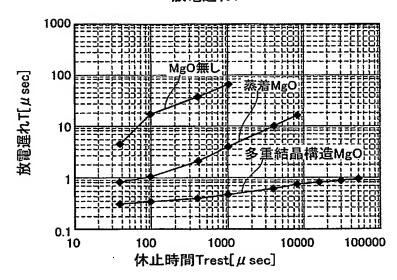
【図10】

放電確率(休止時間1000 μ sec⁻¹)

	実測値	規格化1	規格化2
多重結晶構造MgO	89.8	826.4	39.09
蒸着MgO	2.3	21.1	1.00
MgO無	0.1	1.0	0.05

【図11】

放電遅れT



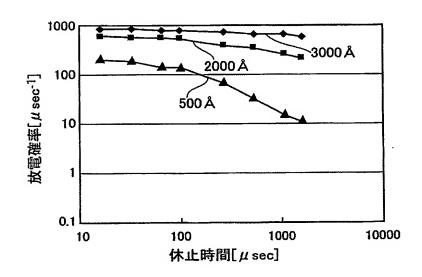


【図12】

放電遅れ(休止時間1000 μ sec)

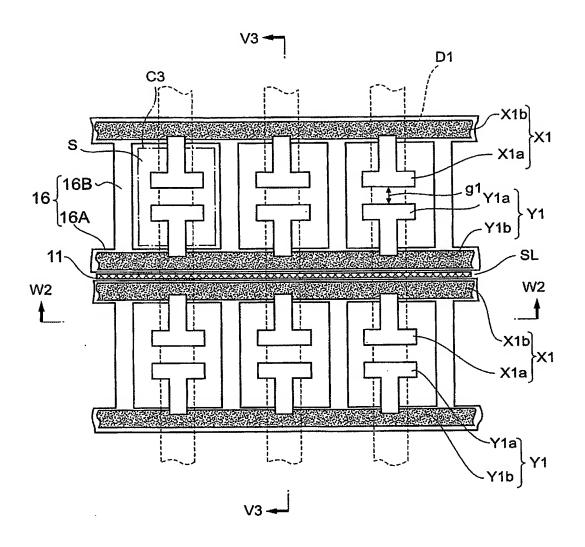
	実測値	規格化1	規格化2
多重結晶構造MgO	0.5	0.01	0.12
蒸着MgO	4.0	0.06	1.00
MgO無	65.0	1.00	16.25

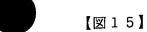
【図13】

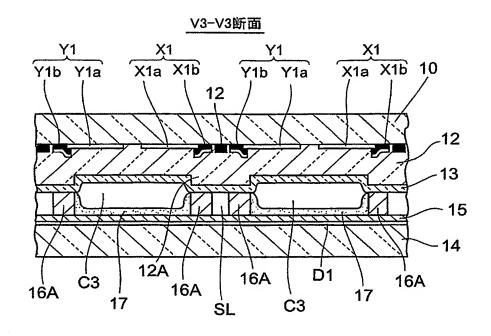




第2実施例

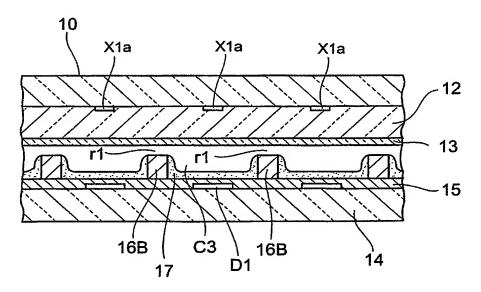




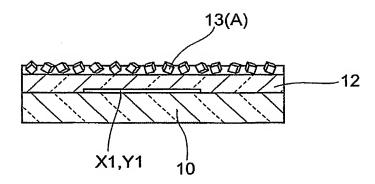


【図16】

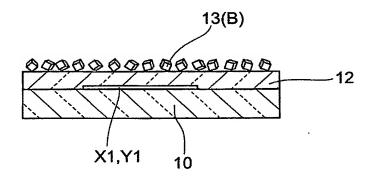






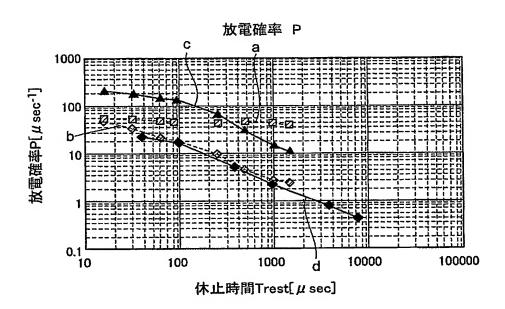


【図18】





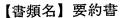
【図19】



---**◇--**- 前面__蒸着MgO

<u> ▲</u> Aセル_500Å

_→ Aセル_蒸着MgO



【要約】

【課題】 PDPの放電特性を改善する。

【解決手段】 前面ガラス基板1と背面ガラス基板4の間の放電空間に形成されたアドレス放電セルC2内に、立方体の多重結晶構造の酸化マグネシウム単結晶体粉末を含む酸化マグネシウム層8が設けられている。

【選択図】

図 2

認定 · 付加情報

特許出願の番号 特願2004-052194

受付番号 50400316012

書類名 特許願

担当官 第一担当上席 0090

作成日 平成16年 3月 2日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成16年 2月26日



特願2004-052194

出願人履歴情報

識別番号

[000005016]

1. 変更年月日

1990年 8月31日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都目黒区目黒1丁目4番1号

氏 名 パイオニア株式会社